

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年8月12日(12.08.2021)



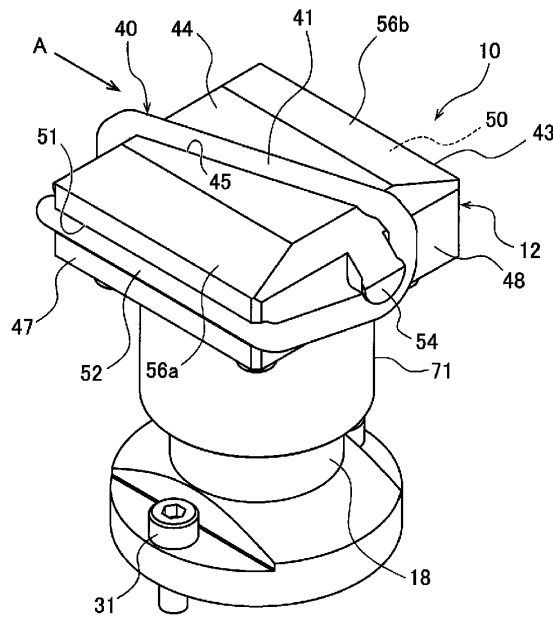
(10) 国際公開番号

WO 2021/157276 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 21/00 (2006.01) *B24B 41/047* (2006.01)
B24B 21/08 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
B24B 21/16 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/000326
- (22) 国際出願日: 2021年1月7日(07.01.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-018043 2020年2月5日(05.02.2020) JP
- (71) 出願人: 株式会社荏原製作所 (EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 柏木 誠 (KASHIWAGI, Makoto); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 廣澤 哲也, 外 (HIROSAWA, Tetsuya et al.); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 8 号 GOWA西新宿 4 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

(54) Title: POLISHING HEAD AND POLISHING DEVICE

(54) 発明の名称: 研磨ヘッドおよび研磨装置



(57) Abstract: The present invention pertains to a polishing head for pressing a polishing tool against a substrate such as a wafer. The present invention also pertains to a polishing device for polishing a substrate with such a polishing head. A polishing head (10) is provided with: an annular elastic member (40) for pressing a polishing tool (3) against a substrate (W); and a pressing tool body (43) having a pressing surface (44) for pressing the polishing tool (3) against the substrate (W) via the elastic member (40). The pressing surface (44) has a first fitting groove (45) into which a first site (41) of

[続葉有]

WO 2021/157276 A1

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

the elastic member (40) fits. The first site (41) protrudes out from the pressing surface (44). The elastic member (40) is caught onto the pressing tool body (43) in an elastically deformed state. The polishing head (10) is configured so that the polishing tool (3) is pressed against the substrate (W) by the first site (41).

(57) 要約: 本発明は、ウェーハなどの基板に研磨具を押し付けるための研磨ヘッドに関するものである。また、本発明はそのような研磨ヘッドで基板を研磨するための研磨装置に関するものである。研磨ヘッド(10)は、研磨具(3)を基板(W)に対して押し付けるための環状の弾性部材(40)と、弾性部材(40)を介して研磨具(3)を基板(W)に対して押し付ける押圧面(44)を有する押圧具本体(43)とを備え、押圧面(44)は、弾性部材(40)の第1部位(41)が嵌合する第1嵌合溝(45)を有し、第1部位(41)は、押圧面(44)から突出しており、弾性部材(40)は弾性変形した状態で押圧具本体(43)に掛けられており、研磨ヘッド(10)は、第1部位(41)により研磨具(3)を基板(W)に押し付けるように構成されている。